

浙江省科学技术奖公示信息表

推荐单位（盖章）：浙江上方电子装备有限公司

提名奖项：科学技术进步奖

成果名称	G8.5/8.6代 TFT-LCD 及 AMOLED 用溅射镀膜设备
提名等级	科学技术进步奖二等奖
提名书 相关内容	<p>知识产权目录：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 旋转阴极磁棒及具有旋转阴极磁棒的旋转靶材，授权专利号：ZL201410197122.4 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：赵军、刘钧、陈金良、许倩斐2. 一种适用于面板静态阵列式镀膜的真空装置，授权专利号：ZL202120326005.9 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：来华杭、娄国明、俞峰、周海龙3. 电致变色器件离子化方法、制备方法及产品，授权专利号：ZL201710978658.3 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：张永夫、俞峰、周海龙、王晓东4. 一种工艺气体分布均匀的磁控溅射真空镀膜设备，授权专利号：ZL201822006776.0 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：刘杰、来华杭、施成亮5. 上方磁控溅射镀膜设备控制系统软件 V1.0，授权专利号：2018SR603001 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：俞峰、周海龙、赵军、张永夫、来华杭6. 一种准静态镀膜系统及利用其进行准静态镀膜的方法，授权专利号：ZL2014110194596.3 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：赵军、陈金良、刘钧、许倩斐7. 用于真空镀膜的玻璃基板架及其镀膜系统和镀膜系统的传输方法，授权专利号：ZL201410197259.X 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：赵军、刘钧、陈金良、许倩斐8. 一种扫描镀膜装置及扫描镀膜组件，授权专利号：ZL201110900208.0 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发

	<p>明人：赵军、梅芳、陈金良、苏永顺</p> <p>9. 一种溅射距离可调的磁控溅射真空镀膜装置，授权专利号：ZL201822006643.3 权利人：浙江上方电子装备有限公司，发明人：娄国明、来华杭、麻春雷、江嘉、李赢</p>
<p>主要完成人</p>	<p>周海龙，排名 1，高级工程师（公示中），浙江上方电子装备有限公司</p> <p>俞峰，排名 2，工程师，浙江上方电子装备有限公司</p> <p>赵军，排名 3，高级工程师，浙江上方电子装备有限公司</p> <p>张永夫，排名 4，高级工程师，浙江上方电子装备有限公司</p> <p>来华杭，排名 5，工程师，浙江上方电子装备有限公司</p> <p>王晓东，排名 6，工程师，浙江上方电子装备有限公司</p> <p>刘杰，排名 7，工程师，浙江上方电子装备有限公司</p> <p>麻春雷，排名 8，工程师，浙江上方电子装备有限公司</p> <p>娄国明，排名 9，工程师，浙江上方电子装备有限公司</p>
<p>主要完成单位</p>	<p>浙江上方电子装备有限公司</p>
<p>提名单位</p>	<p>绍兴市人民政府</p>
<p>提名意见</p>	<p>该项目获得“国家重点产业振兴和技术改造高技术产业专项”的支持，自主设计开发的 G8.5/8.6 代 TFT-LCD 及 AMOLED 用溅射镀膜设备，完成了大量创新性技术工作：一、研制了适用于 G8.5/8.6 TFT-LCD 及 AMOLED 用溅射镀膜设备的大尺寸旋转阴极镀膜源，提出了镀膜源阵列式分布设计方案，并在该设备实现了应用，靶材利用率达到 75%。二、研发和设计了工艺腔内靶基距可调机构及工艺气体调节装置、准静态和动静态镀膜技术，有效提高了大面积薄膜制备的均匀性和质量稳定性。三、提出了旋转靶源和玻璃基板支撑斜立式倾角设计方案，并在该设备实现了应用，使大尺寸超薄玻璃基板的破片率降低至百万分之三十（30PPM）。</p> <p>该项目产品已实现规模化生产和应用，近三年，累计形成销售收入超过 2 亿元。设备最大玻璃基板尺寸 2250mm×2600mm，膜厚均匀性、材料利用率、系统开动率及基板破片率等主要技术指标，处国际同类产品先进水平，突破了我国显示领域“卡脖子”关键装备技术，满足高性能新型显示面板生产要求。该项目具有良好的经济效益，市场前景广阔。</p>

	<p>提名该项目为浙江省科学技术进步奖二等奖。</p>
--	-----------------------------